

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 2 部門第 4 区分
 【発行日】平成 25 年 10 月 17 日 (2013.10.17)

【公開番号】特開 2009-137286 (P2009-137286A)
 【公開日】平成 21 年 6 月 25 日 (2009.6.25)
 【年通号数】公開・登録公報 2009-025
 【出願番号】特願 2008-286980 (P2008-286980)
 【国際特許分類】

B 2 9 C 59/02 (2006.01)

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

【F I】

B 2 9 C 59/02 Z

H 0 1 L 21/30 5 0 2 D

【誤訳訂正書】
 【提出日】平成 25 年 8 月 29 日 (2013.8.29)

【誤訳訂正 1】
 【訂正対象書類名】特許請求の範囲
 【訂正対象項目名】全文
 【訂正方法】変更
 【訂正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

押型 (1) の構造 (16) を大面積の基板 (4) の平坦面 (4s) に転写するためのシステムにおいて、

前記基板 (4) を基板受容表面 (3a) 上で受け取る基板ホルダ (3) と、

前記基板受容表面 (3a) に対して平行に方向付けられ、かつ対向して位置することができる、前記押型 (1) の構造表面 (1s) と、

前記基板受容表面 (3a) に対して直交して働くアクチュエータデバイス (10) と、
 を有するシステムであって、

前記アクチュエータデバイス (10) が、前記構造 (16) の転写を確実にする、かつ前記基板受容表面 (3a) に対して直交することになる力 F_a を前記押型 (1) または基板 (4) に加えるために、少なくとも 2 つの別々に制御可能な、かつ / または調節可能なアクチュエータ (10.1、10.2、... 10.n) を有し、

前記アクチュエータが、前記押型の前記構造の立体形状あるいは前記押型の前記構造の充填率に基づいて制御可能なかつ / または調節可能とされることを特徴とするシステム。

【請求項 2】

それぞれの場合において、別々に制御可能な、かつ / または調節される引張りおよび / または圧縮力 (F_1 、 F_2 、... F_n) を、前記アクチュエータ (10.1、10.2、... 10.n) 上で調整することができる、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 3】

制御ライン (14) を介して前記アクチュエータ (10.1、10.2、... 10.n) に接続される中央制御デバイス (15) によって前記アクチュエータ (10.1、10.2、... 10.n) を制御することができる、請求項 1 または 2 に記載のシステム。

【請求項 4】

前記アクチュエータデバイス (10) が、3 つの別々に制御可能な、かつ / または調節可能なアクチュエータ (10.1、10.2、... 10.n) を有する、請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項 5】

前記アクチュエータデバイス(10)が、前記引張力および/または圧縮力(F_1 、 F_2 、... F_n)を前記押型(1)に伝達する、特に前記押型(1)を中央位置で受け取る押型ホルダ(2)を有する、請求項1から4のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項6】

前記アクチュエータ(10.1、10.2、...10.n)が、特に120°の中間角度で、前記押型ホルダ(2)の周縁上で均一に分配されて配置される、請求項1から5のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項7】

前記アクチュエータデバイス(10)が、前記引張力および/または圧縮力(F_1 、 F_2 、... F_n)を前記基板ホルダ(3)に伝達する、請求項1から4のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項8】

前記アクチュエータ(10.1、10.2、...10.n)が、特に120°の中間角度で、前記押型ホルダ(2)の周縁上で均一に分配されて配置される、請求項7に記載のシステム。

【請求項9】

前記アクチュエータ(10.1、10.2、...10.n)が、前記構造表面(1s)の外側に位置合わせされる、請求項1から8のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項10】

前記押型(1)と平行に前記基板(4)を並進させ回転方向付けるために、調整デバイス(6)が設けられる、請求項1から9のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項11】

前記調整デバイス(6)、前記基板ホルダ(3)、前記押型(1)が、下部ベースプレート(9)と、前記下部ベースプレート(9)に対して平行に方向付けられる押型ベースプレート(12)との間に配置される、請求項10に記載のシステム。

【請求項12】

前記下部ベースプレート(9)が、特に前記ベースプレート(9)および前記押型ベースプレート(12)の縁部に取り付けられる接続用支持体(7)を介して前記押型ベースプレート(12)にしっかり接続される、請求項11に記載のシステム。

【請求項13】

前記アクチュエータ(10.1、10.2、...10.n)が、前記押型ベースプレート(12)を貫通し、前記押型ベースプレート(12)に対して直交して前記押型ベースプレート(12)内に案内されて入る、請求項11または12に記載のシステム。

【請求項14】

前記引張力および/または圧縮力(F_1 、 F_2 、... F_n)を測定するために、前記押型(1)または基板(4)と、前記アクチュエータ(10.1、10.2、...10.n)のそれぞれとの間に、特に圧電型の力測定セル(10k)が設けられる、請求項1から13のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項15】

前記力測定セル(10k)が、前記制御ライン(14)を介して前記中央制御デバイス(15)に接続され、前記中央制御デバイス(15)が、それぞれの場合において前記アクチュエータ(10.1、10.2、...10.n)に関連付けられる対応する力測定セル(10k)の測定値を用いて前記アクチュエータ(10.1、10.2、...10.n)を制御および/または調節するように設計される、請求項14に記載のシステム。

【請求項16】

結果として生じる力 F_a が、前記アクチュエータデバイス(10)の制御によって、前記基板(4)と押型(1)の間の接触表面の面積の中心において作用する、請求項1から15のいずれか一項に記載のシステム。